

## SEM&EDX Integration System (走査電子顕微鏡&エネルギー分散型 X 線分析装置)

**装置の概要** 材料表面の観察 (2次電子, 反射電子像), 元素分析ができる. 低真空中での観察も可能.

**キーワード** SEM, 電子顕微鏡, EDX, エネルギー分散型 X 線分析装置

**装置の型** SEMEDX TypeN, 日立製作所

**購入年度** 2000 年

**設置場所** 工学部 2 号館 1 号棟 2 階 M205 第 2 設計工学  
研究室

- 主な仕様**
- 1) 高真空モード分解能 : 3.5 nm (二次電子像)
  - 2) 低真空モード分解能 : 4.5 nm (反射電子像)
  - 3) 倍率 :  $\times 15 \sim \times 300 \text{ k}$ , 加速電圧 0.3~30 kV
  - 4) 最大試料寸法  $\phi 150 \text{ mm}$
  - 5) 表面形状の観察 (2次電子像), 組成 (反射電子像) 元素分析 (EDX) が可能.

**管理責任者** 岩井善郎 (工学部機械工学科) 27-8544, 内線 2766, iwai@mech.fukui-u.ac.jp

